

薄层电阻测试结构的研究

孙湧, 桂力敏, 吴敏玲

()

中图分类号:

摘要: 叙述了Van der Pauw (VDP) 测试结构的基本原理及测量方法。试制了七种这类的测试结构。用圆形VDP结构和四种不同形状的十字形结构对基区、发射区的薄层电阻进行了测量, 以检查扩散的均匀性, 不同结构测得结果基本相符。用十字——桥结构测量了窗口的有效宽度, 用平面四探针结构测量了单晶衬底的电阻率。结果说明测试结构确是监察工艺的有效工具。

关键词: 无

 [阅读文章\(pdf\)](#)

关闭本页